

産総研出願特許公開情報

研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部門技術移転室にご相談下さい。

産総研知的財産部門 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo (@aist.go.jp を付けてください)

2011年 2月公開分(59件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2011-019526	ラクトシルセラミドを生産する遺伝子組換え植物、およびその利用	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2011-020475	秘密鍵登録システム及び秘密鍵登録方法	株式会社東海理化電機製作所 独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2011-020889	反応焼結基窒化ケイ素セラミックス及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2011-020916	焼結セラミックス成形用組成物、焼結セラミックスの製法、及びセラミックス	株式会社東京大学TLO 独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2011-022066	3次元物体位置姿勢計測方法	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2011-022440	MEMSベースの露光モジュール及び関連技術	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2011-023757	炭化ケイ素半導体装置および炭化ケイ素半導体装置の製造方法	三洋電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2011-024501	糖液の製造方法	東レ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2011-024741	熱影響が極小で微細形状が形成された管、軸材及びその加工方法	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2011-024773	X線成分計測装置	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2011-025121	非アスベスト化処理方法	独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2011-025283	スピニング加工方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2011-025313	電磁波照射を用いた材料の接合方法及び接合装置	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2011-025333	接合体	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2011-025341	電解、レーザ複合加工方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2011-026160	窒化アルミニウム単結晶用原料およびその製造方法、並びに窒化アルミニウム単結晶およびその製造方法	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2011-026161	窒化物単結晶とその製造装置	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2011-026162	窒化アルミニウム単結晶とその製造方法および製造装置	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2011-026188	チタン酸アルカリ金属化合物及びその製造方法、並びに該チタン酸アルカリ金属化合物を含む電極活物質及び該電極活物質を用いてなる蓄電デバイス	石原産業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2011-026199	カーボンナノチューブ均一分散有機溶媒の製造方法及びカーボンナノチューブ均一分散ポリマー樹脂の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2011-026270	生体リズムの制御剤	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
22	特開2011-026413	ガス化方法及びガス化設備	財団法人電力中央研究所 財団法人 石炭エネルギーセンター 株式会社IHI 独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2011-026489	循環流動層ガス化システムにおける熱分解炉及びガス化炉の温度制御システム	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2011-026490	ガス化システムにおけるガス化炉への触媒供給方法	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2011-026491	循環流動層ガス化炉構造	独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2011-026578	混合ガスの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2011-027528	低速陽電子パルスビーム寿命測定方法及び測定装置	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2011-029229	有機光電変換装置	独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2011-029573	トンネル磁気抵抗素子およびスピントランジスタ	独立行政法人科学技術振興機構 独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2011-030445	マイクロチップおよび培養条件探索方法	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2011-031154	二酸化炭素の浅帯水層貯留	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2011-031215	水素発生用触媒及び水素発生方法	独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2011-032206	SSEA系新規糖鎖化合物	独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2011-032241	芳香族置換脂肪族ケトン化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2011-032578	第5族元素及び／又は第6族元素の溶解方法	独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2011-033236	粘性物質希釈装置	アイシン精機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2011-033247	粘性物質希釈装置	アイシン精機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2011-033963	導波路型光ゲートスイッチ及び多段導波路型光ゲートスイッチ	学校法人慶應義塾 独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2011-035015	不揮発性光メモリ素子とメモリデバイス及びその読み出し方法	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2011-036760	水に分散可能なナノ粒子及びナノ粒子分散液の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2011-036765	吸着用シート及び塗工液	三菱製紙株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2011-037711	無機材料成形体の製造方法、並びに無機材料焼結体の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2011-037755	生体リズムの制御剤	独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2011-037933	循環流動層ガス化反応炉	独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2011-038024	ポリアミド酸微粒子、ポリアミド微粒子の連続製造法	独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2011-038072	多孔体とその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
47	特開2011-038175	二層薄膜構造体、超電導物質三層薄膜構造体及びその製造方法	株式会社日本製鋼所 独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2011-038797	レーザー脱離イオン化質量分析用試料基板、これを用いたレーザー脱離イオン化質量分析方法及び装置	国立大学法人名古屋大学 独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2011-038952	特定の糖鎖構造を有する糖タンパク質を検出することにより癌を検出する方法	愛知県 学校法人東京医科大学 独立行政法人産業技術総合研究所
50	特開2011-039043	電気泳動用支持体およびそれを用いた生体成分の分離分析法。	独立行政法人産業技術総合研究所
51	特開2011-039354	光ファイバ伝送系	オーケーラボ有限公司 独立行政法人産業技術総合研究所
52	特開2011-039452	情報記録媒体の製造方法及び情報記録媒体	国立大学法人北見工業大学 独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2011-040343	多孔質発熱装置とその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2011-040459	多積層量子ドット構造体および製造方法、それを用いた太陽電池素子および発光素子	独立行政法人産業技術総合研究所
55	特開2011-040659	電子素子及びその製造方法	国立大学法人 岡山大学 独立行政法人産業技術総合研究所
56	WO2009/048119	高機能化キメラ蛋白質を含有する医薬組成物	独立行政法人産業技術総合研究所
57	WO2009/048114	ガス精製方法	大陽日酸株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
58	WO2009/047857	磁気抵抗素子を用いた増幅装置	キヤノンアネルバ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
59	WO2009/044882	同位体ダイヤモンド積層体	独立行政法人産業技術総合研究所